AirSentry® II Mobile

可搬型AMCモニタリングシステム

Mobile airborne molecular contamination detection system for cleanrooms

Without measurement there is no control

クリーンル ーム大気中の分子状汚染物質 (AMC：airborne molecular contaminant) は、電子デバイスや製造装置の性能に影響を及ぼし、歩留ロスや製品劣化の原因になります。適切なモニタリングが、迅速で的確なAMC汚染対策の実施につながります。

イオン モビリティ スペクトロメトリ (IMS) による移動測定が可能なAirSentry II 移動式AMCモニタリングシステムは、スピーディな汚染源の特定にとても有効です。システムには、IMSアナライザ、コンプレッサ、エアドライヤ、CDAタンク、真空ポンプ、UPSなど、サンプリングとAMC測定に必要なコンポーネントがすべて揃っており、測定ポイントに移動後すみやかにモニタリングを開始することができます。

システムに搭載されたタッチパネル PC には Facility Netモニタリングソフトウェアがプリインストールされており、測定結果のリアルタイム表示やレポートの生成、データの保存などを行います。

特長

- クリーンルーム内のAMCの変動をリアルタイムに測定し、測定結果をリアルタイムに表示
- 移動測定が可能なため、AMC発生源の特定に有用
- IMSアナライザのAirSentry II AMCモニターを3台まで搭載可能
- AirSentry II AMCモニターは4つのモデル (アンモニア、アミン、酸、および塩化化合物用)から選択可能
- コンプレッサ、エアドライヤ、CDAタンク、真空ポンプをシステムに内蔵
- 電源に接続せずに、約30分の継続測定が可能 (UPSが満充電状態の場合)

PARTICLE MEASURING SYSTEMS®
a spectris company

AirSentry® II Mobile

可搬型AMCモニタリングシステム

仕様

カート寸法(奥行き、幅、高さ)	100 x 65 x 126 cm	
重量	141kg	
分析ガス接触面	テフロン™、316ステンレス綱	
CDA品質	露点- 60 ℃以下、ケミカルフィルター処理済み	
CDA容量	1000 cc/minを約30分供給可能	
移動時稼働時間　(100%充電時)	約30分	
常設CDA接続口 (低振動モード)	1/4インチ スウェージロック	
真空源	25 kPa (未満)、1500 cc/min	
搭載可能なIMSアナライザ (LOD - 検出限界、3 s)	AirSentry II酸、0〜50 ppbv AirSentry IIアミン、0〜50 ppbv AirSentry IIアンモニア、0〜50 ppbv AirSentry II塩化物、0〜50 ppbv	LOD = 0.2 ppbv LOD = 0.2 ppbv LOD = 0.2 ppbv LOD = 0.5 ppbv
温度範囲	15〜28 ℃ (動作時)、-40〜50 ℃ (保管時)	
湿度範囲	30〜50% RH (動作時)、0〜90% RH (保管時)	
通信ポート	イーサネット、USB	
ソフトウェア	Facility Net および AirSentry II Serviceソフトウェア	
オペレーティングシステム	Windows® 10	
設備要件: ユーザーが供給する電源 (単相)	110 VAC、60 Hz または 230 VAC、50 HZ	
CEマーキング	適合	

PMS Japan

PMS日本支社
(スペクトリス株式会社 PMS事業部)

〒210-0024
神奈川県川崎市川崎区日進町7-1 川崎日進町ビル4F

Tel: 044 589 3498
Fax: 044 245 5000
Email: pmsjapan@pmeasuring.com

サービスセンター (校正・修理)
Tel: 044 589 3418
Email: SVCpmsjapan@pmeasuring.com

www.pmeasuring.com/jp/

PARTICLE MEASURING SYSTEMS®
a spectris company

AirSentry®はParticle Measuring Systems, Inc.の登録商標です。
Windows®はMicrosoft Corporationの登録商標です。
テフロン™はChemours Companyの商標です。
その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
記載されている仕様は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
© 2018 Particle Measuring Systems, Inc. All rights reserved.

2025.03